1Pa106

DFT-PBC 法を用いた Si(111)洗浄表面上への Tl 原子の吸着に関する理論的研究

(九大院総理工・九大院理) 茂木孝一・〇鹿子木亮太・関谷博

[序] シリコン単結晶の表面に異種原子を吸着させることにより、表面新物質を作り、その原子配 列を決定し、新物性を探索する研究が盛んに行われている。表面の研究では、原子の配列等の表 面構造の決定が重要な因子であり、低速電子回折(LEED)等の実験的研究が行われている。例えば、 第13 族元素である Al, Ga, および In 原子の Si(111)表面への吸着は、T₄(3-fold filled)サイトへの 吸着であり、(√3x√3)-R30°構造であることが明らかにされている。これら表面構造においては、 第13族原子が+3価の状態をとっており、各原子が第1層のSi原子の3個のダングリングボンド と3個の化学結合を形成している。それらの結合により、表面のダングリングボンドは全て打ち 消され、表面は熱力学的に安定化する。同じ 13 族原子である Tl 原子が Si(111)表面へ吸着する場 合も、同様の表面構造であることが予想される。しかし、Tl原子は+3価だけでなく+1価の状態 を示すことが知られており、栃原等は Si(111)-(1x1)-TI 構造における TI 原子の吸着サイトが T4 サイトであることを実験的に決定した。1)この系に関して過去に行われた理論的研究では、クラ スターモデルが用いられており、高い電子相関を考慮した分子軌道計算(MRSDCI計算等)によ っても調査がなされている。それらの研究では、Al,Ga,および In 原子については実験結果と一 致した結果が得られているが、Tl 原子に関してだけは一致しておらず、T₁ (on-top)サイトへの吸 着エネルギーが T₄ サイトより大きいという結論に至っている。Si(111)洗浄表面において等価な Si原子は、本来、等価な電荷分布を示すはずだが、これらの研究においてはクラスターモデルが

用いられているため、その描象をうまく記述できてい ない。そこで本研究では、周期境界条件を用いた密度 汎関数法 (PBC-DFT) を用いて Tl / Si(111)の構造決 定を行い、実験値と比較すると同時に、Tl/Si(111)に おいてどのような原子・分子間相互作用がみられるか などを分子軌道法の観点から理論的に検討した。 [方法] 図1に今回 PBC-DFT 法による計算を実行する にあたって用いた Si(111)表面の Unit cell を示す。 PBC 計算には、Si 洗浄表面の第4層まで考慮した Unit Cell を用いた。なお、第4層のSi原子のダング リングボンドはH原子を用いて terminate した。構造 最適化には密度汎関数の一種である PBEPBE 法を用 いた。基底関数として、ECPの一種である SBKJC 基底関数を用いた(TI:5111/5111/311)。さらに、Si に関しては、d分極関数を加えた(Si: 31/31/1, d=0.45).

[結果および考察] 図 2 に Si(111)表面 Unit cell の Mulliken 電子密度解析の結果を示す。理論計算に PBC を取り入れることにより、Si(111)洗浄表面にお



図 1 Unit cell for Si(111) surface. (a,b は transition vector を示す。)



図 2 Si(111)表面の Unit cell についての Mulliken 電子密度解析

いて等価なSi原子は等価な電荷分布を示すという描象が図2から明らかに分かる。また、Unit cell における第1層のSi原子はカチオン性、第2層のSi原子はアニオン性をおびているが、このこ とから、吸着原子であるTl原子がカチオン状態をとりやすいことを考慮すると、第2層のSi原子(つまりT4サイト)に配位しやすいことが示唆される。

表1には、今回の研究により得られた Tl / Si(111)に関する、サイト、吸着構造、Tl 原子の酸 化数、及び Si(111)洗浄表面に Tl 原子が 1 個吸着することにより得られる安定化エネルギー Δ $E_{stabilization}$ を示す。また、構造最適化を行った系に関しては、Tl 原子・Si 距離(*Re*)も示す。表 1 から、Tl / Si(111)では Si(111)・(1x1)・Tl 構造をとり Tl 原子は+1 価の状態で存在しているという こと、また、この構造における Tl 原子の吸着サイトが T₄サイトであるという実験結果と一致し ていることが分かる。さらに、T₄(1x1)におけるに *Re* に関しては、実験値と完全に一致した結果 が得られた。

Site(structure)	Oxidation number of Tl	$\Delta E_{stabilization}(eV)$	<i>Re</i> (Å)
$T_1(1x1)$	+1	-6.86	2.85
$T_4(1x1)$	+1	-8.35	3.16
$T_1(\sqrt{3}x\sqrt{3})$	+3	-2.00	2.74
$T_4(\sqrt{3}x\sqrt{3})$	+3	-2.99	2.86
$T_1(\sqrt{3}x\sqrt{3})$	+1	-2.07	-
$T_4(\sqrt{3}x\sqrt{3})$	+1	-2.45	-

表1 ΔEstabilization, Tl 原子の酸化数及び Re

図3にSi(111)-(1x1)-TI構造においてTI原子がT4サイトにどのような相互作用で吸着している かが最も明瞭に現れている occupied MO 一例を示す。vdW 半径の大きい+1 価の状態のTI原子 間には結合性の MO がみられ、また、その結合性の MO は Si(111)表面のダングリングボンドに も張り出している。Si(111)-(1x1)-TI 構造においてTI原子がT4サイトに吸着した表面では、表面 に吸着した各 TI原子は、最近接する6 個の TI原子により6 配位されており、TI原子間で電子が 非局在化した金属結合が形成されていることがわかる。このような吸着した TI原子間での相互作 用の存在は、ほかの13 族原子のSi(111)洗浄表面への吸着機構との大きな相違点となっている。 また、ダングリングボンドを持つ第1層のSi原子は吸着した TI原子から3配位されており、第 1層のSi原子は、電子が非局在化した TI原子団に対して SP3結合を形成していることもわかる。



図 3 Si(111)-(1x1)-Tl 構造における Tl 原 子の T₄ サイトへの吸着に関与している occupied MO。左図は Top of view で右図 は Side of view を示す。

1)T.Noda ,S.Mizuno ,J.Chung , H. Tochihara , Jpn. J .Appl. Phys. 42. No.313 (2003) 1319